

(部門共通・運要 5-1-5)

(公募掲載様式)

委員会委員公募掲載様式

委員会名 (所属部門) 【技術委員会】	超微細リソグラフィ技術調査専門委員会 (基礎・材料・共通部門) 【光応用・視覚技術委員会】	委員会での調査・検討項目の概要, 委員長のメッセージ等 (100字程度)	
設置期間	平成14年4月～平成17年3月	超微小集積回路製造用の最先端リソグラフィ技術について調査する。毎回2件ずつ講演を依頼し、話題になっている技術の課題、今後の動向等を質疑応答を行いながら把握する。議論は非常に活発である。委員には自身または自社の技術について最低1回発表またはアレンジをお願いする。	
委員長名(所属)	堀内敏行(東京電機大学)		
委員会開催頻度	5回/年		
問合せ・ 公募 受付 先	氏名 (所属)		堀内敏行 (東京電機大学)
	電話		03-5280-3405
	FAX	03-5280-3571	
	E-mailアドレス	horiuchi@p.dendai.ac.jp	
応募いただきたい方の専門分野, 経験など	リソグラフィおよびその応用技術		
応募締切	平成14年6月末日		
協同研究委員会の場合の委員の負担		千円/年	